

- デュアル光コムエリプソを用いて、実行可能な実験：
C.-H Hsieh, et al. [1]は干渉型エリプソ（光源：He-Ne レーザ）を用いて、高次の波長板の光学定数及び次数を精密に計測した。
その実験方法は、

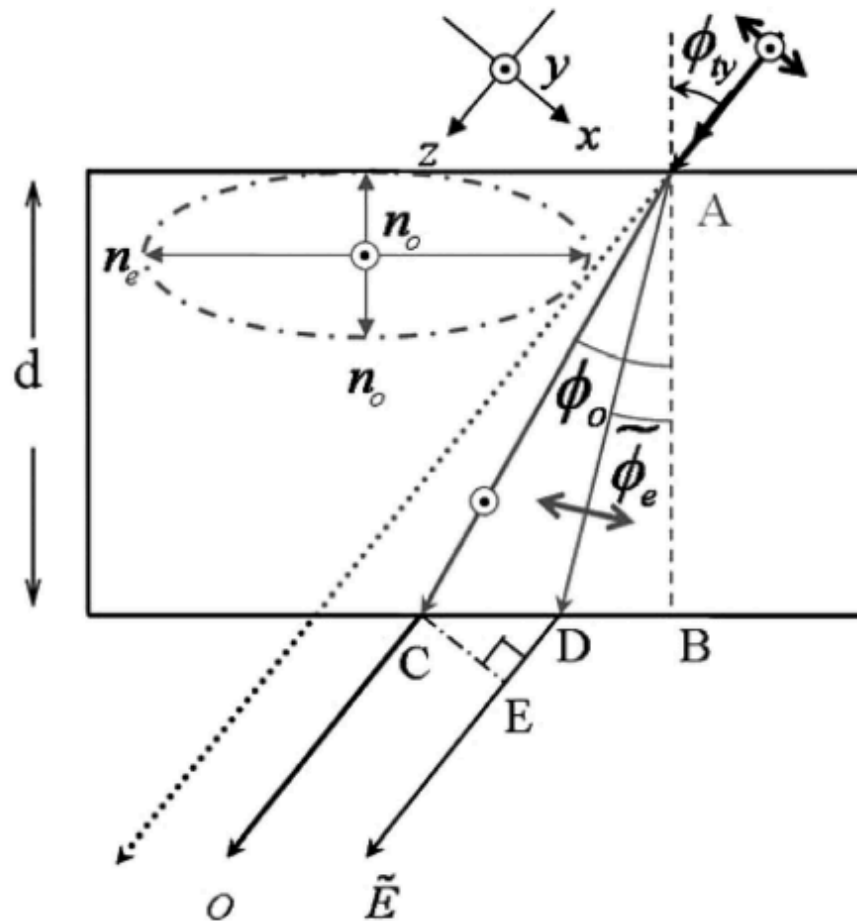


図 1 示すような波長板に対する入射角度を 0 度から 0.05 度ずつ 15 度まで、入射角度によって位相差を計測する。数学モデルでフィテイングによって、波長板の n_e , n_o , 及び次数(m)を推測できた。
この手法では、フィテイングするため 100 回の計測が必要される。
また、大きな入射角度によるエラーが発生する。

- 光コムを用いて、入射角度の変化の代わりに多数の波長により、一回計測で光学定数の推測は可能？